

職員各位

専門研修委員会

令和2年度技術職員専門研修の実施について（通知）

KEK Professional training course for technical and engineering staff

令和2年度技術職員専門研修（機器分析研修）を以下のとおり実施いたします。

1. 概要

装置の開発および維持管理において、不純物の測定やトラブルの原因となった物質の特定などをする場合、環境安全管理室に分析依頼を申し込むことが出来る。また、分析機器の使用を申し込み、自ら機器を操作して測定することも可能である。（環境安全管理室の業務に支障がない場合に限る）自分で測定するためには、原理を理解したうえで操作方法の習得が必要となる。本研修では、非破壊での定性分析が可能な、卓上型 X 線回折装置、卓上型電子顕微鏡+エネルギー分散型 X 線分析装置、フーリエ変換赤外分光光度計の3種類の分析機器に対し、原理についての講義及び分析実習を行い、機器の基本的な操作法の習得を目的とする。実習では金属や樹脂等の固体試料を分析対象とする予定である。研修は技術職員を主に対象とするが、技術職員以外の方も参加可能とする。

2. 研修日程

令和3年3月11日(木) 13:00~16:40 （座学：45分、実習：各55分）

3. 研修場所

KEK つくばキャンパス 化学実験棟

4. 担当講師

加速器科学支援センター 平 雅文 氏

共通基盤研究施設 放射線科学センター 古宮 綾 氏

共通基盤研究施設 放射線科学センター 石田 正紀 氏

5. 対象者

技術系職員のうち、主幹もしくはグループリーダーの了承を得た者

「機器分析講習」受講申込書に必要事項を記入の上、主幹もしくはグループリーダーのサインをもらい了承を得ること。

受講申込書：<https://www2.kek.jp/engineer/tsukuba/senmon/> 開催案内参照

6. 定員

10名程度

7. 募集期間

令和3年2月4日(木)～3月4日(木) 定員になり次第締切

8. 申し込み先・担当職員連絡先

共通基盤研究施設 専門研修委員 黒澤(PHS:4267 東海 C : 029-284-4267)

メールアドレス：s-kenshuu@ml.post.kek.jp

9. その他

新型コロナウイルスの感染拡大状況によっては、研修を中止とする場合があります。ご了承ください。